(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年10月2日(02.10.2025)

WIPO | PCT

(10) 国際公開番号
WO 2025/205176 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/677 (2006.01)

(21) 国際出願番号： PCT/JP2025/010225

(22) 国際出願日： 2025年3月17日(17.03.2025)

(25) 国際出願の言語： 日本語

(26) 国際公開の言語： 日本語

(30) 優先権データ：
特願 2024-056518 2024年3月29日(29.03.2024) JP

(71) 出願人: 東京エレクトロン株式会社(**TOKYO ELECTRON LIMITED**) [JP/JP]; 〒1076325 東京都港区赤坂五丁目３番１号 (JP).

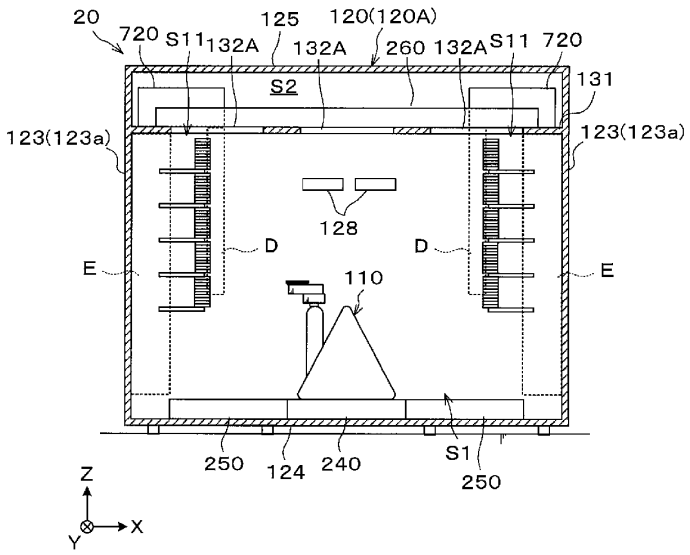
(72) 発明者: 笠 間 一 樹 (**KASAMA, Kazuki**); 〒4070192 山梨県韮崎市穂坂町三ツ沢６５０ 東京エレクトロン株式会社内 (JP). 豊巻 俊明(**TOYOMAKI, Toshiaki**); 〒9813629 宮城県黒川郡大和町テクノヒルズ１番 東京エレクトロン宮城株式会社内 (JP).

(74) 代理人: 金本 哲男，外(**KANEMOTO, Tetsuo** et al.); 〒1620065 東京都新宿区住吉町１－２０ 角張ビル 曙国際特許事務所 (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR,

(54) **Title:** TRANSFER DEVICE AND GAS SUPPLY METHOD

(54) 発明の名称： 搬送装置及び給気方法



(57) **Abstract:** This transfer device for carrying in and out a substrate to and from a processing device for processing a substrate includes a body that has: a transfer space in which a transfer robot for transferring the substrate is provided; and a storage space which is connected to the transfer space and in which the substrate is supported. The body comprises: a first fan filter unit that is disposed above the transfer space and sends out gas to be supplied to the transfer space; a second fan filter unit that is provided separately from the first fan filter unit and sends out gas to be supplied to the storage space;

WO 2025/205176 A1

［続葉有］

HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UY, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能):ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一　国際調査報告(条約第21条(3))

a gas supply passage for supplying the gas sent out from the second fan filter unit to the storage space; and a discharge passage for discharging the gas supplied to the storage space.

(57) 要約:基板を処理する処理装置に対して基板を搬入出する搬送装置であって、前記基板を搬送する搬送ロボットが設けられる搬送空間と、前記搬送空間に連結され、前記基板を支持するストレージ空間と、を有する本体部を有し、前記本体部は、前記搬送空間の上方に配置され、前記搬送空間に供給される気体を送り出す第１ファンフィルターユニットと、前記第１ファンフィルターユニットとは別に設けられ、前記ストレージ空間に供給される気体を送り出す第２ファンフィルターユニットと、前記第２ファンフィルターユニットから送り出された気体を前記ストレージ空間に供給する給気路と、前記ストレージ空間に供給された気体を排気する排気路と、を備える。